

## บทที่ 8

### สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

ในงานวิจัยนี้ได้สร้างระบบเตรียมฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์ในชั้น ประกอบด้วยระบบเคลือบฟิล์มบางโดยการระเหยผลึกคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์ภายใต้สุญญากาศ และระบบแอนนัลในกระบวนการซีลีไนต์เซชัน

สำหรับการเตรียมฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์มี 2 วิธีคือ

1. การระเหยฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์ภายใต้ระบบสุญญากาศ แล้วนำไปปรับโครงสร้างด้วยการซีลีไนต์เซชันในระบบแอนนัล

พบว่าฟิล์มบางที่ระเหยได้มีผิวเรียบ สภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ ไม่มีโครงสร้างผลึกแบบซาลโคไพไรท์ แต่หลังจากปรับโครงสร้างโดยการแอนเนลที่อุณหภูมิ  $400^{\circ}\text{C}$  เป็นเวลาไม่เกิน 4 ชม. จะได้ฟิล์มบางที่มีโครงสร้างผลึกแบบซาลโคไพไรท์ สภาพต้านทานไฟฟ้าสูงขึ้น ชนิดการนำไฟฟ้ามีทั้งแบบเอ็นและแบบพี ( โดยมากเป็นแบบเอ็น ) ปัญหาจากการแอนนัลคือ ฟิล์มบางมีการลอกเกิดขึ้นตามปริมาณของซีลีเนียมในเนื้อฟิล์ม เนื่องจากซีลีเนียมสามารถกลายเป็นไอได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า  $400^{\circ}\text{C}$  ( ที่ความดัน  $1.3 \times 10^{-2}$  mbar. ซีลีเนียมสามารถระเหยเป็นไอได้ด้วยอุณหภูมิ  $234^{\circ}\text{C}$  ) จึงได้เปลี่ยนวิธีการเตรียมใหม่

2. การระเหยฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซัลไฟด์ภายใต้บรรยากาศของซีลีเนียม และปรับอุณหภูมิของแผ่นรองรับ

พบว่าฟิล์มบางที่ระเหยได้มีผิวเรียบ ความสม่ำเสมอของเนื้อฟิล์มจะขึ้นกับอุณหภูมิของแผ่นรองรับที่คงที่ ฟิล์มบางชุดที่เปลี่ยนอุณหภูมิของแผ่นรองรับเป็น 250, 300, 350,  $400^{\circ}\text{C}$  ภายใต้บรรยากาศซีลีเนียม  $I_{\text{Se}} = 32 \text{ A}$   $S_{\text{e}} = 1 \text{ shot/quartz}$  ได้ฟิล์มบางที่มีโครงสร้างผลึกที่มีค่าคงที่โครงสร้างผลึกใกล้เคียงกันคือ ค่า  $a \approx 5.7883 - 5.7938 \text{ \AA}$  ,  $c \approx 11.5748 - 11.5860 \text{ \AA}$  และ  $c/a \approx 1.9992 - 2.0005$  ใกล้เคียงกับการรายงานของผู้อื่น [ 7 ] ความสมบูรณ์ของโครงสร้างผลึกที่ระนาบ (112) ในฟิล์มบางจะมีซ้ำมากขึ้นตามอุณหภูมิของแผ่นรองรับ จากการวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนมากกว่า  $10^5$  (1/cm) สอดคล้องกับการรายงานของผู้อื่น [10 ] ค่าช่องว่างแถบพลังงานจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของแผ่นรองรับ

ลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของฟิล์มบาง เมื่อเตรียมที่อุณหภูมิของแผ่นรองรับต่ำคือ 250, 300°C มีชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบเอ็น สภาพต้านทานไฟฟ้าสูง ( $>100 \Omega\text{cm.}$ ) และเมื่อเตรียมที่อุณหภูมิของแผ่นรองรับสูงคือ 350, 400°C มีชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบพี สภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ ( $< 1 \Omega\text{cm.}$ ) เนื่องจากที่อุณหภูมิสูง  $\text{In}_2\text{Se}_3$  ในฟิล์มบางสามารถระเหยออกมาได้ ทำให้ปริมาณ  $\text{Cu/In}$  มากกว่า 1 จึงมีสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำ ส่วนค่าสภาพเคลื่อนที่ได้ของฮอลล์จะมีค่าลดลงและความหนาแน่นของพาหะมีค่ามากขึ้นเมื่ออุณหภูมิของแผ่นรองรับสูงขึ้น

สำหรับฟิล์มบางคอปเปอร์อินเดียมไดซีลีไนด์ชนิดที่เตรียมโดยอุณหภูมิของแผ่นรองรับคงที่ ( $T_{\text{sub}} = 300^\circ\text{C}$ ) โดยเปลี่ยนอัตราการเคลือบของซีลีเนียมตามในรูปที่ 7.4 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเพิ่มขึ้นตามอัตราการเคลือบของซีลีเนียมและค่าช่องว่างแถบพลังงานมีค่าคงที่ประมาณ 1.01 eV. ส่วนค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นและชนิดการนำไฟฟ้าจะเปลี่ยนจากแบบเอ็นไปเป็นแบบพีตามอัตราการระเหยของซีลีเนียม เนื่องจากเมื่อ  $\text{Se} > (\text{Cu} + \text{In})$  จะได้ฟิล์มบางที่มีชนิดการนำไฟฟ้าเป็นแบบพีสอดคล้องกับการรายงานของผู้อื่น [ 25 ]

ข้อเสนอแนะ ด้านระบบระเหยฟิล์มบาง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของแผ่นกั้นการแผ่รังสีความร้อน เพื่อให้สามารถปรับอุณหภูมิของแผ่นรองรับได้สูงเกินกว่า 400°C , การดัดแปลงภาชนะบรรจุแผ่นรองรับให้สามารถหมุนได้ เพื่อให้ฟิล์มบางที่เตรียมได้มีความสม่ำเสมอมากขึ้น ส่วนการซีลีไนด์เซชันสามารถทำในระบบระเหยสารโดยปรับอุณหภูมิของแผ่นรองรับแล้วระเหยซีลีเนียมไปบนฟิล์มบางในอัตราที่สูงกว่าการกลายเป็นไอของซีลีเนียมจากเนื้อฟิล์มบาง เป็นต้น